

主な特許歴

- 1.X線式坪量測定装置
- 2.O型フレーム及び測定装置
- 3.放射線測定方法
- 4.放射線測定方法および放射線測定装置
- 10.X線管
- 12.放射線検査装置
- 13.膜厚測定方法および装置
- 14.放熱機構
- 15.X線測定装置
- 17.放射線測定方法及び放射線測定装置
- 23.多層膜の膜厚測定方法およびその装置
- 24.放射線検出装置及びこの装置を用いた放射線検出方法
- 27.繊維配向強度の較正方法
- 28.繊維配向角の較正方法
- 29.移動量測定機能付きセンサおよび測定装置
- 30.X線式厚さ測定装置
- 33.フィルム特性測定装置
- 34.シート端検出装置
- 35.インフレーション装置
- 36.プリント基板の製造方法
- 37.配向計
- 39.タイヤ空気圧測定システムおよびタイヤ空気圧測定方法
- 40.物理量測定方法
- 41.配向測定方法及び配向測定装置
- 43.空気緩衝袋製造方法及び装置
- 44.幅方向プロファイル測定方法およびその装置
- 45.シート状物質のプロファイル測定方法
- 46.厚さ測定装置及びその測定方法
- 47.測定位置のずれ補正方法およびそれを用いたシート状製品の幅方向プロファイル測定装置
- 48.ブローンフィルム製造装置
- 49.インフレーション装置
- 51.プロファイル測定装置
- 54.中空状物体の特性値測定方法およびそれを用いた特性値測定装置
- 55.位置制御装置およびそれを用いた厚さ計
- 56.光学的厚さ計
- 57.アラーム表示のための信号調節回路
- 58.抄紙機／塗工機制御装置
- 59.繊維配向計
- 62.スキャン型センサの位置ずれ補償装置
- 63.ガスの供給制御装置
- 64.ウェハ搬送装置
- 66.レーザダイオードアレイを用いた露光装置